## 仮想インベッセルコイルを用いたQUESTダイバータプラズマ形状再構成 QUEST Divertor Plasma Shape Reproduction with Virtual In-Vessel Coil

中村 一男<sup>1</sup>, 劉 暁龍<sup>2</sup>, 薛 二兵<sup>1</sup>, 夏凡<sup>3</sup>, 御手洗 修<sup>4</sup>, 栗原 研一<sup>5</sup>, 川侯 陽一<sup>5</sup>, 末岡 通治<sup>5</sup>, 長谷川 真<sup>1</sup>, 徳永 和俊<sup>1</sup>, 図子 秀樹<sup>1</sup>, 花田 和明<sup>1</sup>, 藤澤 彰英<sup>1</sup>, 松岡啓介, 出射 浩<sup>1</sup>, 永島 芳彦<sup>1</sup>, 川崎 昌二<sup>1</sup>, 中島 寿年<sup>1</sup>, 東島 亜紀<sup>1</sup>, 荒木 邦明<sup>1</sup>, 福山 淳<sup>6</sup>
K. Nakamura<sup>1</sup>, X.L. Liu<sup>2</sup>, E.B. Xue<sup>1</sup>, F. Xia<sup>3</sup>, O. Mitarai<sup>4</sup>, K. Kurihara<sup>5</sup>, Y. Kawamata<sup>5</sup>, M. Sueoka<sup>5</sup>, M. Hasegawa<sup>1</sup>, K. Tokunaga<sup>1</sup>, H. Zushi<sup>1</sup>, K. Hanada<sup>1</sup>, A. Fujisawa<sup>1</sup>, H. Idei<sup>1</sup>, Y. Nagashima<sup>1</sup>, S. Kawasaki<sup>1</sup>, H. Nakashima<sup>1</sup>, A. Higashijima<sup>1</sup>, K. Araki<sup>1</sup>, A. Fukuyama<sup>6</sup>

<sup>1</sup>九大応力研, <sup>2</sup>九大総理工, <sup>3</sup>中国SWIP, <sup>4</sup>東海大, <sup>5</sup>原子力機構, <sup>6</sup>京大工 <sup>1</sup>RIAM, Kyushu Univ., <sup>2</sup>IGSES, Kyushu Univ., <sup>3</sup>SWIP, China, <sup>4</sup>Tokai Univ., <sup>5</sup>JAEA, <sup>6</sup>Kyoto Univ.

QUESTでは球状トカマクプラズマの定常維持法の 一方法として、OHプラズマにてダイバータ配位を形 成し、EBW電流駆動により定常維持することを計画 している。PF35-12直列ダイバータコイルを用いたキ ャンディ状(低δ)ダイバータ配位とPF35-1内側ダイ バータコイルを用いたD形(高δ)ダイバータ配位に ついて、2種類の磁気センサー(フラックスループ、 磁気プローブ)を用いてダイバータ配位プラズマ断面 形状をCCS法にて再構成している。

RF立上/維持プラズマ(右図)に関しては、電流密 度分布が閉磁気面より低磁場側にシフトしている。 EFIT解析では閉磁気面内に電流密度分布(圧力は等 方的)を仮定するため、電流密度分布は閉磁気面内で 低磁場側にシフトするとともに、強磁場側に異符号の 電流密度領域が現れる(下図)。閉磁気面外の低磁場 側開磁気面に沿った仮想インベッセルコイルに全プ ラズマ電流の約30%の電流を仮定すると、異符号の電 流密度領域は消滅する(右下図)。

2種類の磁気センサー(FL, MP)信号により適合条件を強化した場合、圧力分布の異方性に依存しない CCS法を適用した場合の再構成結果についてはポス ターにて報告する。



